



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 103639290 A

(43) 申请公布日 2014. 03. 19

(21) 申请号 201310565437. 5

(22) 申请日 2013. 11. 14

(71) 申请人 梧州恒声电子科技有限公司

地址 543002 广西壮族自治区梧州市长洲区
红岭路 108 号

(72) 发明人 梁承荣

(74) 专利代理机构 广州市越秀区海心联合专
利代理事务所 (普通合伙)
44295

代理人 黄为 蔡国

(51) Int. Cl.

B21D 37/10 (2006. 01)

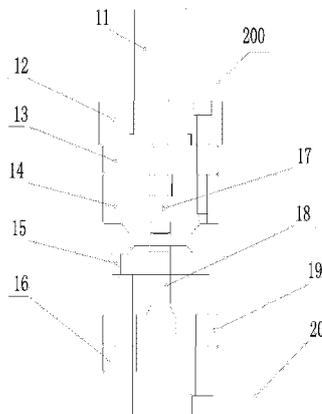
权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54) 发明名称

导磁片的披锋的处理方法

(57) 摘要

本发明公开了一种导磁片的披锋的处理方法,该方法通过一导磁片压角模对导磁片进行披锋处理;导磁片压角模包括上、下模板;在上模板上方装有模柄,在上模板下方装有上垫板,在上垫板下方装有凹模,在凹模上设有卸料板;在下模板上方装下垫板,在下垫板上方安有凸模,在凸模上设有定位板且定位板位于凹模下方;导磁片压角模对导磁片进行披锋处理还包括步骤如下:把披锋面朝上的导磁片放在定位板上并且下模板保持静止不动;上模板下行并对导磁片的披锋面进行压平去除披锋;对导磁片的各个角进行圆弧R角处理或斜角边处理,以使导磁片的各个角变为圆弧R角或斜角边即可。本发明的方法操作简单并且能够方便去除导磁片的披锋及使导磁片更加美观。



1. 一种导磁片的披锋的处理方法,该方法通过一导磁片压角模(200)对导磁片(100)进行披锋处理;其特征在于:

所述导磁片压角模(200)包括上模板(22)和下模板(20);在所述上模板(22)上方安装有模柄(21)以及在上模板(22)下方安装有上垫板(23),在所述上垫板(23)下方安装有凹模(24),在所述凹模(24)上设有卸料板(27);在所述下模板(20)上方安装有下垫板(26),在所述下垫板(26)上方安装有一个凸模(28),在所述凸模(28)上设有用于放置导磁片(100)的定位板(25)并且所述定位板(25)位于所述凹模(24)下方;

上述的导磁片压角模对导磁片进行披锋处理还包括步骤如下:

1.1 把披锋面朝上的导磁片(100)放置在下模板(20)的定位板(25)上并且所述下模板(20)保持静止不动;

1.2 所述上模板(22)下行并对导磁片(100)的披锋面进行压平去除披锋;

1.3 对所述导磁片(100)的各个角进行圆弧R角处理或斜角边处理,以使导磁片(100)的各个角变为圆弧R角或斜角边即可。

导磁片的披锋的处理方法

技术领域

[0001] 本发明涉及一种对导磁片进行辅助处理的方法,尤其涉及一种导磁片的披锋的处理方法。

背景技术

[0002] 目前的导磁片在落料出来后底部都会有一点点披锋(披锋也称为毛刺),见图 1 和图 2 所示,其未能到达产品的平面尺寸要求。另外,传统导磁片的各个角较为不美观。如何解决上述技术瓶颈,成为待攻克的技术难关。

发明内容

[0003] 本发明的目的在于提供一种导磁片的披锋的处理方法,该方法操作简单并且能够方便去除导磁片的披锋及使导磁片更加美观。

[0004] 本发明的技术方案是这样的:

[0005] 一种导磁片的披锋的处理方法,该方法通过导磁片压角模对导磁片进行披锋处理;

[0006] 所述导磁片压角模包括上模板和下模板;在所述上模板上方安装有模柄以及在上模板下方安装有上垫板,在所述上垫板下方安装有凹模,在所述凹模上设有卸料板;在所述下模板上方安装有下垫板,在所述下垫板上方安装有一个凸模,在所述凸模上设有用于放置导磁片的定位板并且所述定位板位于所述凹模下方;上述的导磁片压角模对导磁片进行披锋处理还包括步骤如下:1.1 把披锋面朝上的导磁片放置在下模板的定位板上并且所述下模板保持静止不动;1.2 所述上模板下行并对导磁片的披锋面进行压平去除披锋;1.3 对导磁片的各个角进行圆弧 R 角处理或斜角边处理,以使导磁片的各个角变为圆弧 R 角或斜角边即可。

[0007] 与现有技术相比,本发明在上述方法后,其具有以下有益效果:

[0008] 在本发明中,通过采用导磁片压角模对导磁片的披锋进行处理,并且在处理披锋后,再对导磁片的各个角进行圆弧 R 角处理或斜角边处理,从而使导磁片不但能够符合产品的平面尺寸要求,并且也使产品更加美观耐看。另外,本发明操作非常简单。

[0009] 在结合附图阅读本发明的实施方式的详细描述后,本发明的特点和优点将变得更加清楚。

附图说明

[0010] 图 1 是未能处理掉披锋前的导磁片的结构示意图;

[0011] 图 2 是图 1 所示的 A 部分的局部放大示意图;

[0012] 图 3 是已经处理掉披锋后的导磁片的结构示意图;

[0013] 图 4 是图 3 所示的 B 部分的局部放大示意图;

[0014] 图 5 是导磁片压角模的结构示意图。

具体实施方式

[0015] 下面以一个实施方式对本发明作进一步详细的说明,但应当说明,本发明的保护范围不仅仅限于此。

[0016] 参阅图 3 至图 5,一种导磁片的披锋的处理方法,该方法通过一导磁片压角模 200 对导磁片 100 进行披锋处理。所述导磁片压角模 200 包括上模板 22 和下模板 20;在所述上模板 22 上方安装有模炳 21 以及在上模板 22 下方安装有上垫板 23,在所述上垫板 23 下方安装有凹模 24,在所述凹模 24 上设有卸料板 27;在所述下模板 20 上方安装有下垫板 26,在所述下垫板 26 上方安装有一个凸模 28,在所述凸模 28 上设有用于放置导磁片 100 的定位板 25 并且所述定位板 25 位于所述凹模 24 下方。上述的导磁片压角模 200 对导磁片 100 进行披锋处理还包括步骤如下:1.1 把披锋面朝上的导磁片 100 放置在下模板 20 的定位板 25 上并且所述下模板 20 保持静止不动;1.2 所述上模板 22 下行并对导磁片 100 的披锋面进行压平去除披锋;1.3 对导磁片 100 的各个角进行圆弧 R 角处理或斜角边处理,以使导磁片 100 的各个角变为圆弧 R 角或斜角边即可。经过处理后的导磁片 100 如图 3 和图 4 所示。

[0017] 在本发明中,通过采用导磁片压角模 200 对导磁片 100 的披锋进行处理,并且在披锋进行处理后,再对导磁片 100 的各个角进行圆弧 R 角处理或斜角边处理,从而使导磁片 100 不但能够符合产品的平面尺寸要求,并且也使产品更加美观耐看。

[0018] 虽然结合附图描述了本发明的实施方式,但是本领域的技术人员可以在所附权利要求的范围之内作出各种变形或修改,只要不超过本发明的权利要求所描述的保护范围,都应当在本发明的保护范围之内。

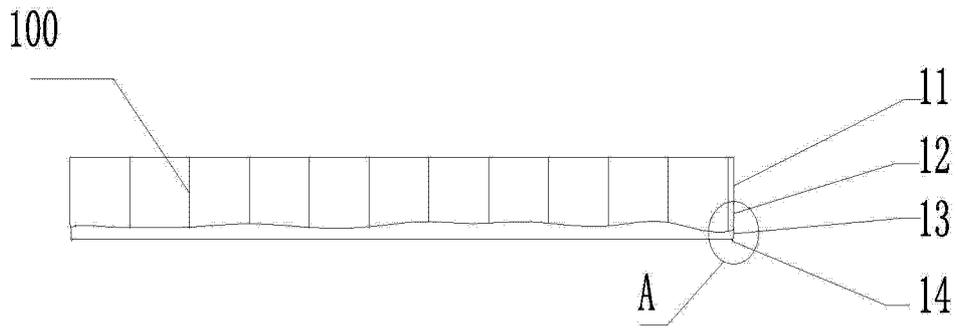


图 1

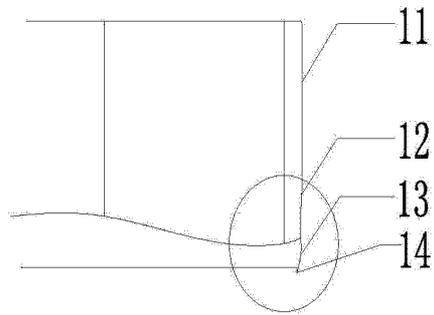


图 2

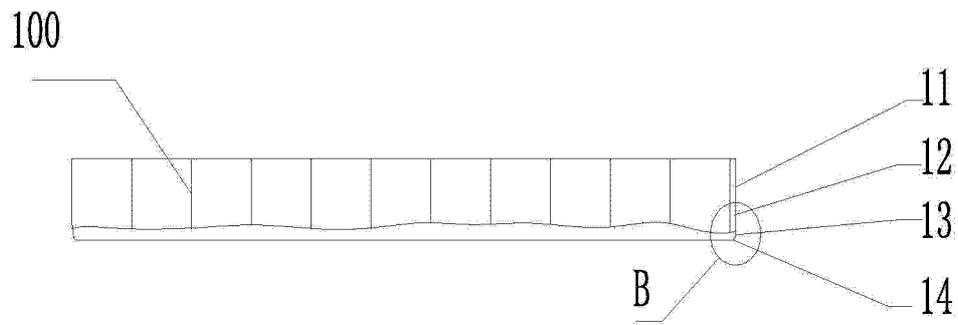


图 3

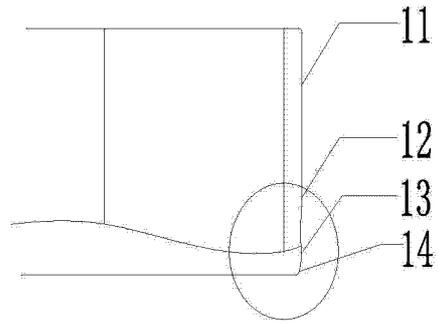


图 4

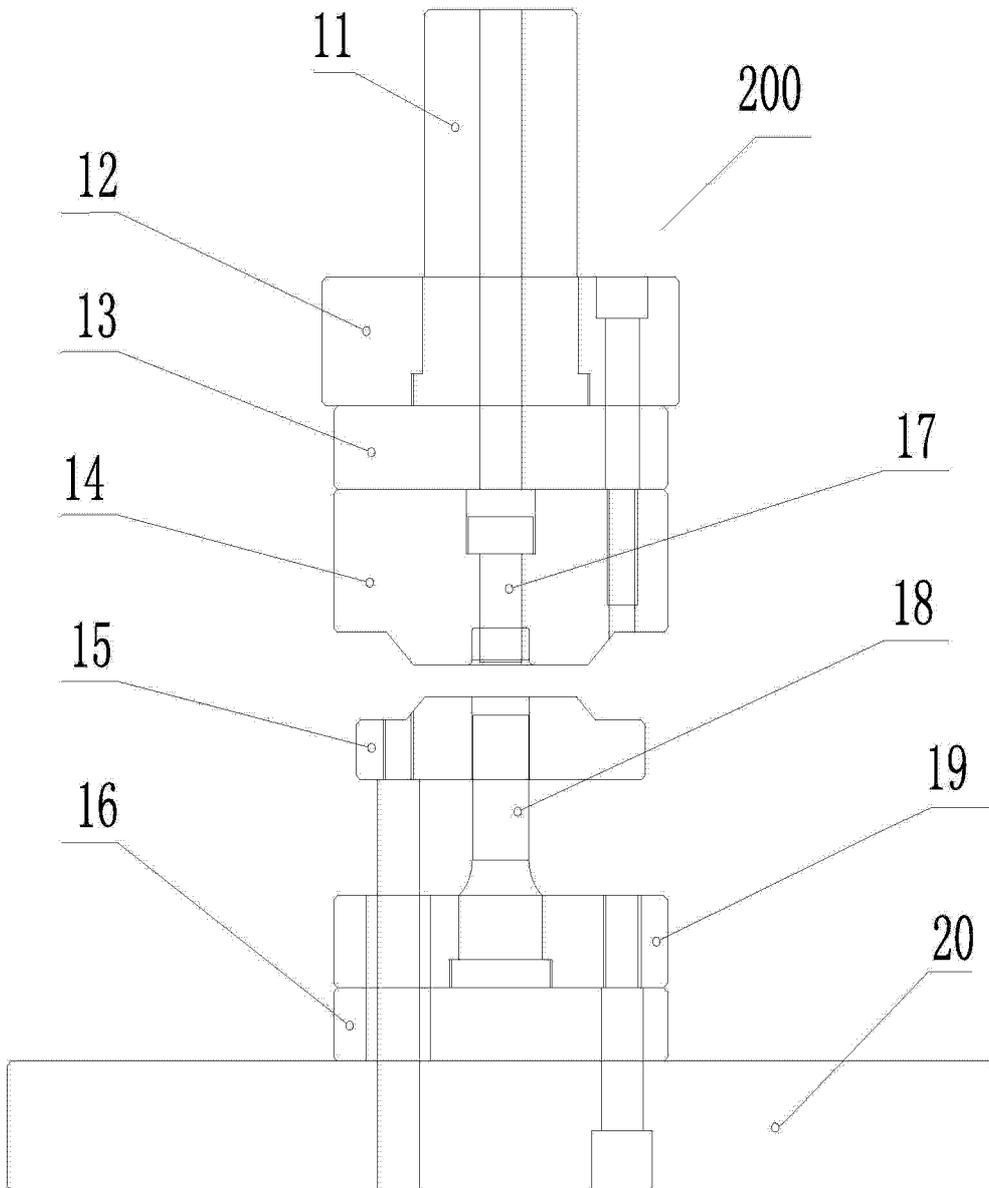


图 5